マシニングセンタに発生する幾何偏差の高精度検出 - レーザによるロール検出 -

金沢大学	金丸裕, 浅川直紀,	中藪俊博
石川県工業試験場	廣崎憲一, 田村陽一	
シグマ光機株式会社	谷内秀夫, 清水昭裕	
津田駒工業株式会社	川原寛之	
松浦機械製作所	天谷浩一	

Highly accurate detection of geometric deviation on a machining center

-Roll detection using laser-

Kanazawa University Yu KANAMARU, Naoki ASAKAWA and Toshihiro NAKAYABU Industrial Reserch Institite of Ishikawa Kenichi HIROSAKI and Youichi TAMURA Siguma Koki Corporation Hideo YACHI and Akihiro SHIMIZU

Tsudakoma Corporation Hiroyuki KAWAHARA

Matsuura Machinery Corporation Koichi AMAYA

On a machining tool, geometric deviations (positional and angular deviation) occurs according to the movement of table and column. A laser measurement system has become popular, because it performs highly accurate measurement of the geometric deviations in the field. We have developed a system which measures all geometric deviations by laser interferometers and mirrors placed on a machining center. In this paper, we focus on the measurement of roll. The system consists of a double-path optical heterodyne laser interferometer and a V-shaped reflector which composed of two plane mirrors. To improve measurement sensitivity, number of laser passes are increased comparing with the former system. From the experimental results, it is confirmed that measurement sensitivity is improved according to the number of laser pass.

<u>1. はじめに</u>

工作機械には、テーブルやコラムなどの移動に伴って3個の 位置偏差(運動方向の位置偏差,運動方向に直角な2方向の直 進偏差)と3個の角度偏差(ピッチ,ヨー,ロール)が発生する. レーザ測長機は、これらの偏差を高精度に測定できる装置とし て広く普及している.しかし、実用的な干渉計と反射鏡が開発 されていないためロール測定だけは未だに困難であり、測定に は精密水準器を代用している⁽¹⁾.しかしながら、水準器によ るロール測定では、テーブルやコラムなどの移動に伴って機械 の重心が移動することにより、機械全体の倒れが測定値へ混入 することが避けられない.また、鉛直移動体に発生するロール については水準器を使用できないという問題がある.そこで本 報ではロールの測定に着目し、測定感度を向上させるためレー ザの往復回数(反射回数)を従来に比べ増加させて実験を行っ た.その結果、レーザの往復回数と感度の関係を確認すること ができたので報告する.

<u>2. ロールの測定</u>

今回用いたロール測定装置の構成を図1に,外観を図2に示 す.干渉計はキューブコーナープリズム(CCP),バイプリズム (BP),1/4 波長板(QP), 偏光ビームスプリッタ(PBS), ターニング



Fig.1 Optical path layout of roll measurement system



Fig.2 Interferometer and V-shaped reflector

ミラー (TM), 平行度調整用偏向子 (W₁,W₂) で構成され,反射鏡 は図のように V 形に配置した 2 枚の平面鏡(以下 V 形反射鏡) で 構成される.平面鏡は平面度 λ/20 の金蒸着鏡を採用している.

測定の原理は,照射された測長用レーザ光のP波(水平直線 偏光)を光路L_{P1},L_{P2}を経てP₁,P₂で,S波(上下直線偏光)を光路 L_{S1},L_{S2}を経て,S₁,S₂でミラーM₁,M₂に垂直に当てる.座標系を 図1のように設定し,Z方向を被測定物の移動方向とする.V 形反射鏡がZ軸回りのγ方向に回転するとP₁,P₂はV形反射鏡 の山側へ移動し,S₁,S₂は谷側へ移動するので,P波とS波が 辿る光路長には相対的に差が発生する.したがってZ軸回りの 角度変化であるロールを,Z方向からレーザの光路差の変化と して検出できることになる.この光路差Δは以前の報告結果⁽²⁾ より次式によって求めることが出来る.ただし,b:図1のP₁と S₂,及びS₁とP₂の距離の1/2, ϕ :L_{P1}とL_{S2},及びL_{S1}とL_{P2}との 挟角の1/2とする.

$$2\Delta = 8b\sin\gamma\cos\phi$$

また式に a (図 1 の P₁ と S₂,及び S₁ と P₂の距離の 1/2)が含まれ ないことから γ (ロール)が微少であれば干渉計と反射鏡との距離や回転中心の位置に関係なく次式でロールが算出することが できる.

Δ	
$\gamma \cong \frac{\gamma}{\left(4b\cos\phi\right)}$	(2)

なお,測長機からは Δ/2 が出力される.

<u>3. 実験</u>

図3は定盤上で行ったレーザ測長機によるロール測定時の機器配列を示す.レーザ測長機(ZYGO製ZMI4000:LH)とロール 測定用干渉計(RI)は光学ベンチ上に固定してある.同じく,光 学ベンチ上にはV型反射鏡(RR)と干渉計との距離Lを変化さ せるための移動ステージを固定してある.移動ステージ上に は,Z軸回りに回転するジンバル構造の手動式微動回転台が固 定してあり,微動回転台上にはRRと,ロールをX方向からピッ チとして検出するためのピッチ測定用反射鏡(PR)を固定してあ る.ピッチ測定用干渉計(PI)はステージ上に固定した.HMは ハーフミラー,TMはターニングミラーを示す.用いたレーザ 測長機の分解能はシングルパスで λ /2048であり,ロールとピッ チの各干渉光は光ファイバーOF_a,OF_aで受光した.

図1はロール測定の基本的な構成を示すもので,V形反射鏡 へのP波とS波の合計反射数は4回である.しかし,これでは ロール検出の感度が低いため,図4の(a)のような再帰反射プリ ズムを干渉計後部に固定することにより,干渉計から光検出器 へ戻ろうとする干渉光を再び干渉計へ入射させ,当初の光路を 逆に辿らせて反射鏡での合計反射数を8回にしたものと,更に 小型再帰反射プリズム2個から成る図4の(b)を干渉計後部に固 定することにより合計反射数を12回にしたものを用いた.また 図3のRIとRRの距離Lを200mm,400mm,600mmと変化させ固 定してからロールの測定を行った.

<u>4.結果</u>

図5にL=400mmの時の発生するロールに伴って検出される 測長量を反射回数毎に比較したもの,図6は干渉計と反射鏡の 距離を変化させて比較したものを各々示す.図6のデータは理 解のため,検出量の初期値をL=400mmでは0.02mm,L=600mm では0.04mmへ移動して図示している.また表1には回帰直線



Optical bench

Fig.3 Method of sensitivity calibration



(a) For 8 point method (b) Fig.4 Cube corner prism (CCP)



(b) For 12 point method

の傾きから得られる単位ロールあたりの検出長さ, すなわちシ ステムの感度を比較したものを示す.

これらより,同一反射回数の傾斜が一定であることから感度 は干渉計と反射鏡との距離に関係なく一定であることが分か る.またシステムの感度は反射回数に比例して向上することが 分かる.

<u>5.おわりに</u>

今回開発したレーザ干渉計においてレーザの反射回数を変化 させた実験を行い,以下の結果を得た.

(1) ロール検出感度は,4 点反射法では0.827 × 10⁵(mm/"),

8 点反射法では 1.638 × 10⁵(mm/"), 12 点反射法では 2.489 × 10⁵(mm/"), と推定された.

(2)12点反射法では4点反射法の3倍の感度が得られることを確認した.

謝辞

本研究は,経済産業省の平成18年度地域新生コンソーシアム 研究開発事業の一部として行ったものであり,お世話になった 経済産業省や財団法人石川産業創出支援機構を始めとする関係 各位に感謝いたします.

参考文献

 Test conditions for machining centers -Part2, JIS B6336-2 (2002-01-20), Japanese Standard Association.

 (2) 中藪俊博, 岡路正博,他:ロール測定用高性能レーザ干渉 計の開発,日本機械学会論文集,C編,75(756),2245-2252, 2009-08-25





reflector distance (12points method)

Table1	Sensitivity	of the	s yst em
--------	-------------	--------	----------

Reflector dist.	Sensitivity C (mm/")			
L(mm)	4 point method	8 point method	12 point method	
200	0.822×10^{5}	1.643×10 ⁵	2.510×10 ⁵	
400	0.827×10^{5}	1.642×10 ⁵	2.463×10 ⁵	
600	0.831×10^{5}	1.628×10 ⁵	2.493×10 ⁵	